

作品

特許移転により（株）日本分光がファイバプローブおよびそれを用いた近接場顕微分光システム（NFS-230C, NFS230/330, NFS-220FT/320FT, NFIR-200）を実用化製作、市販。

発明・特許

国内特許

登録済み

1. 「量子ドットによる解探索システム」、2012年5月22日出願、特願2012-116725号、特開2013-242477号、公開日平成25年12月5日、独立行政法人理化学研究所、大津元一、成瀬誠、川添忠、他、（特許登録日平成28年10月28日：特許第6029048号）
2. 「真贋認証対象物、真贋判定装置、真贋判定方法及び真贋認証対象物の製造方法」、2013年2月28日出願、特願2013-038712号、特開2014-166695号、公開日平成26年9月11日、大日本印刷株式会社、国立大学法人東京大学、国立大学法人横浜国立大学、法元盛久、大八木康之、大津元一、川添忠、豎直也、成瀬誠、松本勉、（特許登録日平成29年1月27日：特許第6081227号）、
3. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成22年4月28日出願、特願2011-511322号、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー、大津元一、八井崇、川添忠、山崎俊輔、梶山康一、水村通伸、伊藤圭一、（特許登録日平成26年6月27日：特許第5564639号）、
4. 「パルス光発生装置」、平成21年9月10日出願、特願2009-209772号、特開2011-59447号、公開日平成23年3月24日、出願人財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、（特許登録日平成26年1月10日：特許第5448666号）（PCT/JP2010/003067 国際公開番号(WO2010/125821) 国際公開日(2010/11/4)、特願2009-112126 優先権主張）
5. 「ナノフォトニックデバイス」、平成19年9月21日出願、特願2007-245939、特開2009-75462号、公開日平成21年4月9日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、（特許登録日平成24年12月28日：特許第5165316号）
6. 「表面平坦化方法」、平成20年1月11日出願、特願2008-004472号、特開2009-167030号、公開日平成21年7月30日、シグマ光機株式会社、田幡能徳、平田和也、大津元一、八井崇、野村航、（特許登録日平成24年11月22日：特許第5139092号）

7. 「階層型情報記録媒体」、平成 19 年 7 月 24 日出願、特願 2007-192447、特開 2009-31360 号、公開日平成 21 年 2 月 12 日、東京大学、大津元一、成瀬誠、堅直也、野村航、八井崇、(特許登録日平成 24 年 11 月 22 日：特許第 5139092 号)
8. 「偏光素子」、平成 19 年 10 月 25 日出願、特願 2007-277968、特開 2009-104074 号 公開日平成 21 年 5 月 14 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、成瀬誠、八井崇(特許登録日平成 24 年 9 月 14 日：特許第 5083883 号)
9. 「表面平坦化方法」、平成 19 年 10 月 10 日出願、特願 2007-264481、特開 2009-94345 号公開日平成 21 年 4 月 30 日、東京大学、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 24 年 7 月 20 日：特許第 5044354 号)
10. 「光アイソレータ、半透過反射式液晶表示装置」、平成 20 年 4 月 2 日出願、特願 2008-096596 号、特開 2009-251128 号、公開日平成 21 年 10 月 29 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 24 年 7 月 16 日：特許第 5030839 号)
11. 「量子ドットを用いた光遅延器」、平成 19 年 9 月 21 日出願、特願 2007-245902、特開 2009-75458 号、公開日 2009 年 4 月 9 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 24 年 6 月 15 日：特許第 5014937 号)
12. 「ナノ構造体の折曲げ方法」、平成 18 年 6 月 15 日出願、特願 2006-166515、特開 2007-331069 号、公開日平成 19 年 12 月 27 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 24 年 3 月 16 日：特許第 4948053 号)
13. 「光機能素子及び光学認証システム」平成 19 年 12 月 20 日出願、特願 2007-328125、特開 2009-151040 号、公開日平成 21 年 7 月 9 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、成瀬誠、川添忠、八井崇、(特許登録日平成 23 年 10 月 14 日：特許第 4843600 号)
14. 「偏光板」、平成 18 年 3 月 31 日出願、特願 2006-98764、特開 2007-272018 号、公開日平成 19 年 10 月 18 日、東京大学、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 22 年 11 月 5 日：特許第 4619977 号)
15. 「偏光板」、平成 18 年 3 月 31 日出願、特願 2006-98765、特開 2007-272019 号、公開日平成 19 年 10 月 18 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 22 年 7 月 30 日：特許第 4559999 号)
16. 「偏光板」、平成 18 年 3 月 31 日出願、特願 2006-98763、特開 2007-272017 号、公開日平成 19 年 10 月 18 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 22 年 7 月 30 日：特許第 4559998 号)
17. 「偏光板」、平成 18 年 3 月 31 日出願、特願 2006-98762、特開 2007-272016 号、公開日平成 19 年 10 月 18 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 22 年 7 月 30 日：特許第 4559997 号)、
18. 「プローブ及びプローブの製造方法、プローブアレイ及びプローブアレイの製造方法」、平成 12 年 4 月 11 日出願、特願 2000-115825、特開 2001-208672 号、公開日平成 13 年 8 月 3 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、株式会社リコー、八井崇、興梠元伸、大津元一、高橋淳一、(特許登録日平成 22 年 7 月 30 日：特許第 4558886 号)、

19. 「送り装置、及びそれを用いた近接場光学顕微鏡」、出願平成12年5月23日出願、特願2000-151530号、公開日平成13年11月30日、特開2001-330547号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、斎藤臣也、斎藤修、大津元一、(特許登録日平成22年3月26日：特許第4480852号)
20. 「近接場光学用プローブ」、平成11年6月1日出願、特願平11-154029号、公開日平成13年1月30日、特開2001-27597号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、井上勉、中村高広、大津元一、(特許登録日平成21年10月9日：特許第4388625号)
21. 「光パルス発生器」、平成10年11月12日出願、特願平10-532230号2、公開日平成12年5月30日、特開2000-151519号、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、興梠元伸、(特許登録日平成21年3月19日：特許第4277099号)
22. 「パターニング方法」、平成13年6月27日出願、特願2004-265881号、公開日平成15年1月15日、特開2003-13236号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、山本洋、(特許登録日平成19年7月6日：特許第3979799号)
23. 「エッチング方法並びにナノデバイスの作製方法」、平成14年11月21日出願、特願2002-338337号、公開日平成16年6月17日、特開2004-172482号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、崔允辰、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成18年6月9日：特許第3814574号)
24. 「レーザ周波数測定方法、レーザ周波数制御方法、レーザ周波数測定装置及びレーザ光発生装置」、平成11年3月26日出願、特願平11-84789号、公開日平成12年10月6日、特開2000-275107号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、(特許登録日平成18年5月19日：特許第3805555号)
25. 「トモグラフィー装置」、平成12年2月18日出願、特願2000-46831号、公開日平成13年8月24日、特開2001-227911号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、(特許登録日平成17年11月11日：特許第3739987号)
26. 「光ピックアップスライダ及びその製造方法」、平成12年4月26日出願、特願2000-125127号、公開日平成13年4月6日、特開2001-93251号、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、八井崇、(特許登録日平成17年2月25日：特許第3649648号)
27. 「近接場光プローブ及びその製造方法」、平成11年5月31日出願、特願平11-15923号、公開日平成12年8月11日、特開2000-222765号、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、(特許登録日平成17年2月4日：特許第3642984号)
28. 「レーザ光源装置」、平成7年8月25日出願、特願平7-217941号、公開日平成9年3月7日、特開平9-64486号大津元一、財団法人神奈川科学技術アカデミー、アンリツ株式会社、興梠元伸、齋藤崇記、(特許登録日平成16年7月2日：特許第3570581号)
29. 「光ファイバ及びその製造方法」、平成7年5月31日出願、特願平8-500660号、国際出願番号PCT/JP95/01068、国際公開日平成7年12月7日、国際公開番号W095/33207、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、物部秀二、松本拓也、(特許登録日

平成 14 年 2 月 15 日：特許第 3278164 号)

(ア) 登録済 (権利消滅)

30. 「アクセス記録可能な光メモリ」、平成 18 年 7 月 14 日出願、特願 2006-194814、特開 2008-21395 号、公開日平成 18 年 7 月 14 日、東京大学、独立行政法人情報通信研究機構、大津元一、八井崇、成瀬誠、(特許登録日平成 22 年 11 月 12 日：特許第 4621895 号) 権利消滅日平成 28 年 11 月 13 日
31. 「太陽電池」、平成 21 年 2 月 19 日出願、特願 2009-37100 号、特開 2010-34499 号、公開日平成 22 年 2 月 12 日優先権主張番号 2008-169364、優先日平成 20 年 6 月 27 日出願人 東京大学、大津元一、川添忠、太田竜一、(特許登録日平成 25 年 1 月 18 日：特許第 5177682 号) 権利消滅日平成 27 年 11 月 6 日 (手続き)
32. 「受光素子の作製方法」、2009 年 11 月 25 日出願、特願 2009-267811 号、特開 2011-114076 号、公開日平成 23 年 6 月 9 日、出願人独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、八井崇、行武壮太郎、(特許登録日平成 25 年 3 月 1 日：特許第 5209592 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
33. 「化合物半導体微粒子の形成方法」、平成 21 年 5 月 15 日出願、特願 2009-118697 号、特開 2010-264564 号、公開日平成 22 年 11 月 25 日、出願人独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、劉洋、鷺津正夫、米澤徹、藤田宏之、(特許登録日平成 25 年 2 月 1 日：特許第 5189553 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
34. 「ノッチゲート素子」、平成 20 年 9 月 18 日出願、特願 2008-238975 号、特開 2010-73852 号、公開日平成 22 年 4 月 2 日、出願人独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 24 年 11 月 30 日：特許第 5142908 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
35. 「蛍光顕微鏡、蛍光観察方法」、平成 21 年 3 月 31 日出願、特願 2009-86891 号、特開 2010-237554 号、公開日平成 22 年 10 月 14 日、出願人独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 24 年 9 月 28 日：特許第 5095663 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
36. 「量子ドットを用いた光遅延器」、平成 21 年 3 月 27 日出願、特願 2009-077929 号、特開 2010-230946 号、公開日平成 22 年 10 月 14 日、出願人独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、劉洋(特許登録日平成 24 年 8 月 17 日：特許第 5065320 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
37. 「量子ドットを用いた光デバイス」、平成 18 年 6 月 9 日出願、特願 2006-161159、特開 2007-329399 号、公開日平成 19 年 12 月 20 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 24 年 8 月 3 日：特許第 5052827 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
38. 「撮像管」、平成 20 年 6 月 18 日出願、特願 2008-158621 号、特開 2010-3416 号、公開日平成 22 年 1 月 7 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 24 年 6 月 29 日：特許第 5025577 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
39. 「金属堆積方法」、平成 18 年 6 月 9 日出願、特願 2006-161158、特開 2007-329398 号、公開日平成 19 年 12 月 20 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特

許登録日平成 24 年 2 月 10 日：特許第 4921861 号) 権利消滅日平成 27 年 2 月 25 日

40. 「量子ドットを用いた光伝送路」平成 19 年 11 月 8 日出願、特願 2007-291128、特開 2009-1116188 号、公開日平成 21 年 5 月 28 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、川添忠、成瀬誠、野村 航、堅直也、(特許登録日平成 24 年 1 月 27 日：特許第 4913016 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
41. 「発光ダイオード素子及びその製造方法」、平成 20 年 3 月 26 日出願、特願 2008-081667 号、特開 2009-238941 号、公開日平成 21 年 10 月 15 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 23 年 11 月 4 日：特許第 4856666 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
42. 「フォトマスク、露光装置及び方法」、平成 18 年 7 月 4 日出願、特願 2006-184587、特開 2008-15098 号、公開日平成 20 年 1 月 24 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 23 年 10 月 7 日：特許第 4838646 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
43. 「紫外光フィルタ」、平成 16 年 9 月 7 日出願、特願 2004-259849、特開 2006-078569 号、公開日平成 18 年 3 月 23 日、独立行政法人科学技術振興機構、株式会社 光コム、大津 元一、川添 忠、興梠 元伸、国際分類 G202B 5/22 2006,1(特許登録日平成 23 年 8 月 26 日：特許第 4808947 号) 権利消滅日平成 27 年 6 月 15 日
44. 「窒化ガリウム単結晶の製造方法」、平成 20 年 3 月 26 日出願、特願 2008-081666 号、特開 2009-234838 号、公開日平成 21 年 10 月 15 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、山崎俊輔、(特許登録日平成 23 年 6 月 17 日：特許第 4763011 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
45. 「プラスチック基板上への ZnO 単結晶の堆積方法」、平成 19 年 9 月 3 日出願、特願 2007-228208、特開 2009-57267 号、公開日平成 21 年 3 月 19 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、北村心、(特許登録日平成 23 年 6 月 17 日：特許第 4762961 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
46. 「光パルス発生素子」、平成 20 年 7 月 24 日出願、特願 2008-191216 号、特開 2010-26463 号、公開日平成 22 年 2 月 4 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 23 年 6 月 3 日：特許第 4753979 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
47. 「回路パターン転写装置及び方法」、平成 17 年 3 月 25 日出願、特願 2005-088861、特開 2006-269936 号、公開日平成 18 年 10 月 5 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 23 年 1 月 28 日：特許第 4674105 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
48. 「情報再生装置及び方法」、平成 17 年 5 月 2 日出願、特願 2005-134117、特開 2006-309904 号、公開日平成 18 年 11 月 9 日、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人科学技術振興機構、成瀬誠、大津元一、八井崇、(特許登録日平成 22 年 9 月 17 日：特許第 4586180 号) 権利消滅日平成 27 年 6 月 15 日
49. 「量子ドットによる近接場光集光器」、原出願平成 14 年 11 月 6 日出願、特願 2002-322913 号、分割 出願平成 18 年 7 月 18 日出願、特願 2006-165691 号、公開日平成 18 年 11 月 16 日、特開 2006-313930 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 22 年 3 月 12 日：特許第 4473241 号) 権利消滅日平成 26

年 11 月 6 日

50. 「量子ドットによる波長変換素子」、原出願平成 14 年 11 月 6 日出願、特願 2002-322913 号、分割 出願平成 18 年 7 月 18 日出願、特願 2006-165690 号、公開日平成 18 年 11 月 30 日、特開 2006-323410 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 22 年 3 月 31 日：特許第 4444930 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
51. 「ナノ細線デバイス及びその作製方法」、特願 2003-378981 号、平成 15 年 11 月 7 日出願、公開日平成 17 年 6 月 2 日、特開 2005-142444 号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 22 年 3 月 31 日：特許第 4444630 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
52. 「量子ドットによる光ゲート素子」、平成 18 年 7 月 18 日出願、特願 2006-195692 号、公開日平成 18 年 10 月 26 日、特開 2006-293402 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 21 年 10 月 23 日：特許第 4393485 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
53. 「光蓄積器」、平成 15 年 8 月 11 日出願、特願 2003-291659 号、公開日平成 17 年 3 月 10 日、特開 2005-064200 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 21 年 10 月 2 日：特許第 4378460 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
54. 「近接場光学顕微鏡」、平成 12 年 5 月 23 日出願、特願 2000-151528 号、公開日平成 13 年 11 月 30 日、特開 2001-330548 号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、大津元一、(特許登録日平成 21 年 6 月 26 日：特許第 4332283 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
55. 「プローブ開口作成装置、及びそれを用いた近接場光学顕微鏡」、平成 12 年 6 月 2 日出願、特願 2000-166238 号、公開日平成 14 年 2 月 20 日、特開 2002-55041 号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、井上勉、照山晋、齋木敏治、物部秀二、大津元一、(特許登録日平成 21 年 6 月 19 日：特許第 4327993 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
56. 「演算回路」、平成 17 年 2 月 28 日出願、特願 2005-53715 号、公開日平成 18 年 9 月 7 日、特開 2006-237515 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 21 年 4 月 10 日：特許第 4290663 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
57. 「ナノインプリント方法及び装置」、平成 17 年 4 月 1 日出願、特願 2005-105806 号、公開日平成 18 年 10 月 19 日、特開 2006-287012 号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、大津元一、(特許登録日平成 21 年 1 月 16 日：特許第 4246174 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
58. 「量子ドットによる光発振器」、平成 18 年 7 月 18 日出願、特願 2006-195689 号、公開日平成 18 年 10 月 26 日、特開 2006-295221 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 21 年 1 月 9 日：特許第 4240407 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
59. 「量子ドットによる光増幅器」、平成 18 年 7 月 18 日出願、特願 2006-195688 号、公開日平成 18 年 10 月 26 日、特開 2006-295220 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 21 年 1 月 9 日：特許第 4240406 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日

60. 「量子ドットによる波長多重装置及び波長分離装置」、平成 18 年 7 月 18 日出願、特願 2006-195687 号、公開日平成 18 年 11 月 2 日、特開 2006-303535 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 21 年 1 月 9 日：特許第 4240405 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
61. 「ナノデバイスの作製方法」、平成 16 年 3 月 26 日出願、特願 2004-92567 号、公開日平成 17 年 10 月 6 日、特開 2005-271185 号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、大津元一、(特許登録日平成 20 年 9 月 26 日：特許第 4190448 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
62. 「距離計」、平成 11 年 6 月 1 日出願、特願平 11-154030 号、公開日平成 13 年 2 月 9 日、特開 2001-33209 号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術専攻機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、久田秀穂、大津元一、(特許登録日平成 20 年 7 月 18 日：特許第 4155668 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
63. 「ナノフォトニックデバイス」、平成 16 年 9 月 13 日出願、特願 2004-265880 号、公開日平成 18 年 3 月 23 日、特開 2006-80459 号、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 20 年 6 月 6 日：特許第 4133984 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
64. 「プローブ顕微鏡」、平成 11 年 5 月 24 日出願、特願平 11-143519 号、公開日平成 12 年 11 月 30 日、特開 2000-329678 号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、久田 秀穂、宮島達哉、斎藤修、渡辺伸一郎、斎藤臣也、阿久津耕二、照山晋、大津元一、(特許登録日平成 19 年 11 月 22 日：特許第 4044241 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
65. 「量子ドットによる光増幅器」、平成 16 年 9 月 13 日出願、特願 2001-194985 号、公開日平成 18 年 3 月 23 日、特開 2006-080460 号、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 19 年 4 月 20 日：特許第 3947748 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
66. 「薄膜の作製方法、並びに微粒子の堆積方法」、平成 15 年 3 月 14 日出願、特願 2003-70723 号、公開日平成 16 年 10 月 7 日、特開 2004-277813 号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、興梠元伸、野村航、大津元一(特許登録日平成 19 年 4 月 6 日：特許第 3939669 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
67. 「ナノ光 D/A コンバータ」、平成 16 年 3 月 26 日出願、特願 2004-93448 号、公開日平成 17 年 10 月 13 日、特開 2005-283651 号、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成 19 年 3 月 2 日：特許第 3923481 号) 権利消滅日平成 27 年 2 月 25 日
68. 「レジストパターン形成方法、デバイスの作製方法」、平成 15 年 1 月 31 日出願、特願 2003-24783 号、公開日平成 16 年 8 月 19 日、特開 2004-235574 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 19 年 1 月 19 日：特許第 3903149 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
69. 「近接場光学顕微分光測定装置」、平成 9 年 9 月 29 日出願、特願平 9-282509 号、公開日平成 11 年 4 月 13 日、特開平 11-101808 号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、斎藤修、宮島達哉、塚田寛、渡辺伸一郎、藤原幹治、池田壮、池田照樹、大津元一、(特許登録日平成 18 年 12

月 8 日：特許第 3889134 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日

70. 「量子ドットによる伝送路」、平成 14 年 11 月 6 日出願、特願 2002-322913 号、公開日平成 16 年 6 月 3 日、特開 2004-157326 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 18 年 8 月 25 日：特許第 3845613 号) 権利消滅日平成 26 年 9 月 2 日
71. 「光化学気相堆積装置及び方法」、平成 14 年 9 月 19 日出願、特願 2002-273539 号、公開日平成 16 年 4 月 8 日、特開 2004-107744 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 18 年 5 月 26 日：特許第 3809410 号) 権利消滅日平成 26 年 11 月 6 日
72. 「ナノデバイスの作成方法及び装置」、平成 14 年 10 月 11 日出願、特願平 2002-299234 号、公開日平成 16 年 4 月 30 日、特開 2004-130479 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、八井崇、大津元一、(特許登録日平成 17 年 9 月 30 日：特許第 3725113 号) 権利消滅日平成 27 年 3 月 25 日
73. 「フォトン走査トンネル顕微鏡」、平成 6 年 3 月 25 日出願、特願平 6-55698 号、公開日平成 7 年 10 月 13 日、特開平 7-260807 号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 13 年 10 月 19 日：特許第 3242787 号) 権利消滅平成 26 年 3 月 25 日
74. 「光周波数コム発生器」、平成 5 年 8 月 17 日出願、特願平 5-203441 号、公開日平成 7 年 3 月 3 日、特開平 7-58386 号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、齋藤崇記、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 18 年 1 月 6 日：特許第 3756959 号) 権利消滅日平成 25 年 8 月 17 日
75. 「フォトマスク、露光装置及び露光方法」、平成 16 年 12 月 22 日出願、特願 2004-370548、特開 2006-178133 号、公開日平成 18 年 7 月 6 日、独立行政法人科学技術振興機構・ウシオ電機株式会社、大津元一、川添忠、鈴木貴之、(特許登録日平成 22 年 8 月 11 日：特許第 4522840 号) 権利消滅日平成 25 年 6 月 4 日
76. 「光ファイバプローブ、測定方法」、平成 14 年 7 月 10 日出願、特願 2002-201628 号、公開日平成 16 年 2 月 12 日、特開 2004-45153 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 17 年 2 月 4 日：特許第 3597181 号) 権利消滅日平成 24 年 9 月 17 日
77. 「レーザ光制御装置及び方法」、平成 10 年 4 月 10 日出願、特願平 10-99571 号、公開日平成 11 年 10 月 29 日、特開平 11-295773 号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 17 年 9 月 9 日：特許第 3718050 号) 権利消滅日平成 24 年 9 月 9 日
78. 「多重光周波数コム発生器」、平成 6 年 12 月 13 日出願、特願平 6-308823 号、公開日平成 8 年 6 月 25 日、特開平 8-166610 号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、アンリツ株式会社、齋藤崇記、興梠元伸、大津元一、Eric Durant、(特許登録日平成 16 年 3 月 26 日：特許第 3537058 号) 権利消滅日平成 24 年 3 月 26 日
79. 「光プローブ」、平成 10 年 12 月 4 日出願、特願平 10-345976 号、公開日平成 12 年 6 月 23 日、特開 2000-171380 号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、八井崇、(特許登録日平成 20 年 6 月 13 日：特許第 4137258 号) 権利消滅日平成

23年6月13日

80. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成10年7月3日出願、特願平11-154030号、公開日平成12年1月21日、特開2000-19091号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、(特許登録日平成20年7月11日：特許第4153089号) 権利消滅日平成23年7月11日
81. 「ピンホールの作製方法及び作製装置」、平成14年10月10日出願、特願2002-297839号、公開日平成16年4月30日、特開2004-130447号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成17年3月4日：特許第3651800号) 権利消滅日平成20年3月4日
82. 「近接場光学顕微鏡用のプローブ」、平成14年3月26日出願、特願2002-86554号、公開日平成15年10月2日、特開2003-279462号、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、(特許登録日平成17年4月22日：特許第3669436号) 権利消滅日平成20年4月22日
83. 「近接場光プローブ及びその製造方法」、平成13年6月27日出願、特願2001-194984号、公開日平成15年1月15日、特開2003-14608号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、アイヤー・エヌ・ヘマントクマール、(特許登録日平成17年5月20日：特許第3677653号) 権利消滅日平成20年5月20日
84. 「波長変換素子及び波長変換方法」、平成13年4月5日出願、特願2001-107620号、公開日平成14年10月18日、特開2002-303902号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、清水貴志、(特許登録日平成18年3月3日：特許第3775781号) 権利消滅日平成21年3月3日
85. 「平面型プローブ及びその形成方法」、平成10年12月16日出願、特願平10-357201号、公開日平成12年6月30日、特開2000-182264号、株式会社リコー・財団法人神奈川科学技術アカデミー、大塚正也、大津元一、興梠元伸、(特許登録日平成17年4月1日：特許第3662134号) 権利消滅日平成23年4月1日
86. 「光触針の保持方法」、平成9年11月28日出願、特願平9-344470号、公開日平成11年6月18日、特開平11-160332号、日本分光株式会社・独立行政法人科学技術振興機構・財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田貴人、井上勉、渡辺伸一郎、池田照樹、大津元一、(特許登録日平成18年10月13日：特許第3866398号) 権利消滅日平成22年10月13日
87. 「光ファイバプローブ及びそれを用いた近接場光学顕微鏡」、平成8年11月25日出願、特願平8-313920号、公開日平成10年6月9日、特開平10-153604号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、(特許登録日平成16年8月27日：特許第3589819号) 権利消滅日平成22年8月27日
88. 「光ファイバ及びその製造方法」、平成7年5月31日出願、特願2000-360381号、公開日平成13年8月10日、特開2001-215186号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、物部秀二、松本拓也、斎木敏治、(特許登録日平成15年10月10日：特許第3481583号) 権利消滅日平成23年10月10日
89. 「周波数標準レーザー装置」、平成6年3月11日出願、特願平6-66469号、公開日平成7年9月26日、特開平7-249815号、財団法人電力中央研究所、藤井崇、根本孝七、

大津元一、(特許登録日平成14年10月25日：特許第3363991号) 権利消滅日平成23年10月25日

90. 「光ファイバプローブの製造方法」、平成9年9月30日出願、特願平9-266868号、公開日平成11年4月23日、特開平11-108939号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、八井崇、大津元一、(特許登録日平成14年8月2日：特許第3335892号) 権利消滅日平成22年8月2日
91. 「プローブ走査型近接場光学顕微鏡」、平成8年3月25日出願、特願平8-68767号、公開日平成9年10月3日、特開平9-257813号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、ラジャゴパラン ウママヘスワリ、大津元一、(特許登録日平成14年3月1日：特許第3281902号) 権利消滅日平成22年3月1日
92. 「光ファイバプローブ」、平成8年6月14日出願、特願平8-154645号、公開日平成10年1月6日、特開平10-2905号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、物部秀二、斎木敏治、(特許登録日平成14年1月11日：特許第3268201号) 権利消滅日平成22年1月11日
93. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成9年7月1日出願、特願平9-176052号、公開日平成11年1月29日、特開平11-23587号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、(特許登録日平成13年12月14日：特許第3260300号) 権利消滅日平成22年12月14日
94. 「近接場光学顕微鏡用プローブ」、平成8年9月6日出願、特願平8-236787号、公開日平成10年3月31日、特開平10-82792号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、(特許登録日平成13年10月19日：特許第3242848号) 権利消滅日平成22年10月19日
95. 「少数の中性原子の運動を制御する方法および装置」、平成4年6月11日出願、特願平4-152442号、公開日平成5年12月24日、特公平05-341100号、東京工業大学長、大津元一、堀裕和、(特許登録日平成6年11月16日：特公平06-093038号、特許登録日平成7年7月10日、特許第1946474号) 権利消滅日平成24年6月11日
96. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成9年9月11日出願、特願平9-262923号、公開日平成11年3月26日、特開平11-83872号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、芦野慎、大津元一、(特許登録日平成13年9月14日：特許3231675号) 権利消滅日平成22年9月14日
97. 「パターンニング方法およびパターンニング装置」、平成9年6月25日出願、特願平9-169154号、公開日平成11年1月22日、特開平11-16856号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、福田浩章、大津元一(特許登録日平成13年6月1日：特許第3194363号) 権利消滅日平成22年6月1日
98. 「微小振動付与装置、微小振動付与方法及び表面状態検出装置」、平成9年8月1日出願、特願平9-208033号、公開日平成11年2月26日、特開平11-51943号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、アンドレイ ツビヤキン、大津元一、(特許登録日平成13年3月9日：特許3167287号) 権利消滅日平成18年3月9日
99. 「平面プローブ及びその製造方法」、平成9年9月30日出願、特願平9-266870号、公開日平成11年4月23日、特開平11-110793号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、

- 興梶元伸、八井崇、大津元一、（特許登録日平成13年2月9日：特許3157754号）
権利消滅日平成23年2月9日
100. 「光ファイバプローブ」、平成8年11月25日出願、特願平8-313921号、公開日平成10年6月9日、特開平10-153605号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、斎木敏治、大津元一、（特許登録日平成13年1月5日：特許第3145643号）権利消滅日平成22年1月5日
101. 「プローブの製造方法」、平成4年10月20日出願、特願平4-281720号、公開日平成6年5月13日、特開平6-130302号（株式会社ニコン、大澤日佐雄、大津元一、特許登録日平成12年12月1日：特許第3134546号）権利消滅日平成15年12月1日
102. 「プローブの製造方法及びプローブ」、平成4年2月26日出願、特願平4-39755号、公開日平成5年9月21日、特開平5-241076号、株式会社ニコン、大澤日佐雄、大津元一、（特許登録日平成12年12月1日：特許第3134456号）権利消滅日平成15年12月1日
103. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成9年9月26日出願、特願平9-262146号、公開日平成11年4月13日、特開平11-101809号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、松本拓也、大津元一、（特許登録日平成12年10月6日：特許第3117667号）権利消滅日平成22年10月6日
104. 「光ファイバプローブの製造方法」、平成7年3月24日出願、特願平7-66281号、公開日平成8年10月11日、特開平8-261921号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、栗原一嘉、大津元一、（特許登録日平成12年9月8日：特許第3107725号）権利消滅日平成22年9月8日
105. 「光ファイバ及びその加工方法、光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成6年3月25日出願、特願平7-55697号、公開日平成7年10月13日、特開平7-261039号財団法人神奈川科学技術アカデミー、ラジャゴパラン ウママヘスワリ、大津元一、（特許登録日平成12年8月11日：特許第3097892号）権利消滅日平成22年8月11日
106. 「光ファイバプローブ」、平成10年3月24日出願、特願平10-75735号、公開日平成11年10月8日、特開平11-271339号財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梶元伸、八井崇、大津元一、（特許登録日平成12年4月7日：特許第3053380号）権利消滅日平成22年4月7日
107. 「集光素子の製造方法」、平成10年3月13日出願、特願平10-63518号、公開日平成11年9月24日、特開平11-258409号財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梶元伸、八井崇、大津元一、（特許登録日平成12年1月14日：特許第3023085号）権利消滅日平成22年1月14日
108. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成6年3月24日出願、特願平6-53626号、公開日平成7年10月13日、特開平7-260459号財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、（特許登録日平成12年1月14日：特許第3023048号）権利消滅日平成23年1月14日
109. 「高調波発生装置」、平成2年10月16日出願、特願平2-275237号、公開日平成4年5月25日、特開平4-151627号、旭硝子株式会社、妹尾忠則、大津元一、（特許登

録日平成 11 年 3 月 19 日：特許第 2900576 号) 権利消滅日平成 20 年 3 月 19 日

110. 「高感度光周波数弁別装置」、平成 2 年 3 月 29 日出願、特願平 2-82187 号、公開日平成 3 年 12 月 11 日、特開平 3-279827 号、東京航空計器株式会社、大津元一、中浜一志、西田健一、今井亨、(特許登録日平成 10 年 9 月 25 日：特許第 2831429 号) 権利消滅日平成 22 年 3 月 29 日
111. 「光プローブ」、平成 15 年 1 月 31 日出願、特願 2003-24784 号、公開日平成 16 年 8 月 19 日、特開 2004-233290 号、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、(特許登録日平成 18 年 4 月 7 日：特許第 3788432 号) 権利消滅日平成 23 年 4 月 7 日、
112. 「量子ドットによる演算回路」、平成 15 年 8 月 11 日出願、特願 2003-291660 号、公開日平成 17 年 3 月 10 日、特開 2005-64201 号、独立行政法人科学技術振興機構、三宮俊、大津元一、(特許登録日平成 19 年 11 月 2 日：特許第 4032103 号)、 権利消滅日平成 22 年 11 月 2 日、
113. 「紫外発光体及びその製造方法」、平成 11 年 8 月 31 日出願、特願平 11-246600 号、公開日平成 13 年 3 月 23 日、特開 2001-77420 号、独立行政法人科学技術振興機構、李謹炯、山本洋、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 17 年 10 月 21 日：特許第 3731147 号)、 権利消滅日平成 21 年 10 月 21 日、
114. 「走査型プローブの製造方法」、平成 13 年 5 月 15 日出願、特願 2001-145309 号、公開日平成 14 年 11 月 27 日、特開 2002-340772 号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、上田稔、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 16 年 7 月 16 日：特許第 3577291 号)、 権利消滅日平成 21 年 7 月 16 日
115. 「プローブ及びその製造方法」、平成 13 年 6 月 5 日出願、特願 2001-169460 号、公開日平成 14 年 12 月 18 日、特開 2002-365195 号、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、川添忠、興梠元伸、大津元一、(特許登録日平成 16 年 7 月 9 日：特許第 3574794 号)、 権利消滅日平成 21 年 7 月 9 日
116. 「基準周波数及びそれを利用した超高精度光周波数システム」、平成 3 年 4 月 6 日出願、特願平 03-073371 号、公開日平成 4 年 10 月 30 日、特開平 04-309277、科学技術振興事業団、大津元一、(特許登録日平成 11 年 11 月 19 日、特許第 3005065 号) 権利消滅日平成 19 年 11 月 19 日
117. 「反射型光走査トンネル顕微鏡」、平成 2 年 8 月 24 日出願、特願平 02-223754 号、公開日平成 3 年 12 月 9 日、特開平 03-278014、科学技術振興事業団、大津元一、(特許登録日平成 11 年 6 月 18 日、特許第 2941911 号)、 権利消滅日平成 20 年 6 月 18 日
118. 「赤外から紫外にわたる超広帯域かつ高コヒーレント光スイープジェネレータ」、平成元年 9 月 16 日出願、特願平 01-240377 号、公開日平成 3 年 4 月 26 日、特開平 03-101719、科学技術振興事業団、大津元一、(特許登録日平成 10 年 12 月 11 日、特許第 2863564 号)、 権利消滅日平成 19 年 12 月 11 日
119. 「半導体レーザのスペクトル線幅狭窄化装置」、昭和 63 年 10 月 14 日出願、特願昭 63-259152 号、公開日平成 2 年 4 月 18 日、特開平 02-1060083、東京航空計器株式会社、大津元一、大津元一、吉田純一、今井亨、(特許登録日、平成 10 年 10 月 14 日、特許第 2823870 号)、 権利消滅日平成 20 年 10 月 14 日

120. 「レーザ励起ルビジウム原子発振器」、平成元年8月21日出願、特願平01-214700号、公開日平成3年4月3日、特開平3-78319、新技術事業団、大津元一、(特許登録日、平成8年5月10日、特公平7-83265、特許第2051977号)、権利消滅日平成20年9月6日
121. 「超高感度光ファイバ・ジャイロスコープ」、昭和59年出願、特願S59-050172号、公開日昭和60年、特開S60-195415、東京工業大学長、大津元一(特公平07-31059号、特許登録日、平成8年1月11日、特許第2005217号)、権利消滅日平成16年4月10日
122. 「アラン分散測定器」、平成2年3月2日出願、特願平2-51417号、公開日平成3年11月11日、特開平03-252263号、アンリツ株式会社、大津元一、衣川茂、(特許登録日平成8年1月10日：特公平08-001449号、特許第2102285号)権利消滅日平成18年1月10日
123. 「アラン分散の測定器」、平成2年3月2日出願、特願平2-51416号、公開日平成3年11月11日、特公平03-252562号、アンリツ株式会社、大津元一、衣川茂、(特許登録日平成8年1月10日：特公平08-001448号、特許第2102284号)、権利消滅日平成18年1月10日
124. 「光走査トンネル顕微鏡」、平成元年9月4日出願、特願平01-230210号、特開03-91710公開日平成3年4月17日、新技術事業団、大津元一、(登録日、平成7年2月8日、特公平07-11629号、特許第1977793号)、権利消滅日平成20年2月8日

公開中

1. 「エレクトロルミネッセンス素子及びその作製方法」、2012年8月24日出願、特願2012-185872号、特開2014-044836号、公開日平成26年3月13日、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、杉森輝彦、大津元一、川添忠
2. 「波長変換シート及びその作成方法」、2012年8月24日出願、特願2012-185871号、特開2014-043503号、公開日平成26年3月13日、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、杉森輝彦、大津元一、川添忠
3. 「近接場光を用いたエッチング方法」、2012年7月12日出願、特願2012-156812号、特開2014-22411号、公開日平成26年2月3日、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、大津元一、八井崇、野村航
4. 「p型ZnOの作製方法、ZnOエレクトロルミネッセンス半導体素子」、2012年1月18日出願、特願2012-8332号、特開2013-149441号、公開日平成25年8月1日、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、大津元一、川添忠、北村心
5. 「投光性基材の表面平坦化方法」、2012年1月12日出願、特願2012-3731号、特開2013-143169号、公開日平成25年7月22日、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、大津元一、八井崇、川添忠、野村航
6. 「ガラスディスクの表面平坦化方法」、2012年1月12日出願、特願2012-3733号、特開2013-142052号、公開日平成25年7月22日、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、大津元一、八井崇、川添忠、野村航

クス工学推進機構、大津元一、八井崇、川添忠、野村航

7. 「半導体レーザダイオード及びその作製方法」、2011年5月16日出願、特願2011-109916号、特開2012-243824号、公開日平成24年12月10日、国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、みなし取下、平成26年8月26日
8. 「偏光変換板、偏光変換方法」、2011年3月8日出願、特願2011-050882号、特開2012-189651号、公開日平成24年10月4日、国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、みなし取下、平成26年5月27日
9. 「エレクトロルミネッセンス素子及びその作製方法」、2012年2月17日出願、特願2012-033369号、特開2012-186162号、公開日平成24年9月27日、国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、
10. 「受光素子の作製方法」、2011年2月16日出願、特願2011-031382号、特開2012-169565号、公開日平成24年9月6日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、
11. 「量子ドットを用いた微小パルス光生成器」、2010年10月26日出願、特願2010-240057号、特開2012-94651号、公開日平成24年5月17日、出願人財団法人光産業技術振興協会、大津元一、成瀬誠、川添忠
12. 「量子ドット連結体の作成方法」、2010年10月26日出願、特願2010-240048号、特開2012-94649号、公開日平成24年5月17日、国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、成瀬誠、豎直也、みなし取下、平成26年1月28日
13. 「偏光板」、2010年6月29日出願、特願2010-148302号、特開2012-13806号、公開日平成24年1月19日、出願人東京大学、大津元一、川添忠、高橋勝人、みなし取下、平成25年9月24日
14. 「被検体損傷分析装置」、2010年3月2日出願、特願2010-045894号、特開2011-180039号、公開日平成23年9月15日、シグマ光機株式会社、大津元一、川添忠、八井崇、野村航、多幡能徳、拒絶査定
15. 「ゾルゲル法による金属酸化物の製造方法」、2010年2月23日出願、特願2010-037690号、特開2011-173746号、出願日平成23年9月8日、出願人東京大学、大津元一、八井崇、劉洋、拒絶査定、平成26年7月18日
16. 「マイクロレンズの作製方法」、2009年12月11日出願、特願2009-281072号、特開2011-123312号、公開日平成23年6月23日、出願人東京大学、八井崇、大津元一、みなし取下、平成25年3月26日
17. 「基板露光装置」、2009年12月7日出願、特願2009-277881号、特開2011-119614号、公開日平成23年6月16日、出願人財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、みなし取下、平成25年3月26日
18. 「基板露光装置」、2009年12月7日出願、特願2009-277880号、特開2011-119613号、公開日平成23年6月16日、出願人財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、みなし取下、平成25年3月26日
19. 「結晶成長方法及び装置」平成21年5月15日出願、特願2009-209761号、特開2011-057512号、公開日平成23年3月24日、出願人国立大学法人東京大学、大津元

一、八井崇、川添忠、野村航、拒絶査定

20. 「信号波形測定装置及び測定方法」、平成 21 年 2 月 27 日出願、特願 2009-45987 号、特開 2010-197359 号、公開日平成 22 年 9 月 9 日、出願人浜松ホトニクス株式会社、国立大学法人東京大学、藤原弘康、川添忠、大津元一、拒絶査定
21. 「電子放出素子の製造方法及び電子放出素子」、平成 20 年 12 月 4 日出願、特願 2008-310284 号、特開 2010-135185 号、公開日平成 22 年 6 月 17 日、出願人独立行政法人科学技術振興機構、日本放送協会、大津元一、八井崇、北村心、斎藤信雄、堺俊克、萩原啓、拒絶査定
22. 「撮像管」、平成 20 年 6 月 18 日出願、特願 2008-158620 号、特開 2010-3415 号、公開日平成 22 年 1 月 7 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、拒絶査定
23. 「液晶表示装置用カラーフィルタ、液晶表示装置」、平成 20 年 4 月 2 日出願、特願 2008-096597 号、特開 2009-251129 号、公開日平成 21 年 10 月 29 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、川添忠、拒絶査定
24. 「波長変換光生成装置及び生成方法」、平成 20 年 3 月 26 日出願、特願 2008-081285 号、特開 2009-237111 号、公開日平成 21 年 10 月 15 日、国立大学法人東京大学、浜松ホトニクス株式会社、大津元一、藤原弘康、川添忠、拒絶査定
25. 「太陽電池用の波長変換素子、太陽電池モジュール」、平成 21 年 2 月 19 日出願、特願 2009-037099 号、特開 2009-223309 号、公開日平成 21 年 10 月 1 日 国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、みなし取下、平成 24 年 5 月 22 日
26. 「蛍光体」、平成 20 年 3 月 4 日出願、特願 2008-053706 号、特開 2009-209265 号、公開日平成 21 年 9 月 17 日、国立大学法人東京大学、日清紡績株式会社、大津元一、成瀬誠、川添忠、大島康弘、堀口晋市、八井崇、みなし取下、平成 23 年 12 月 21 日
27. 「情報再生装置及び方法」、平成 20 年 1 月 11 日出願、特願 2008-004528 号、特開 2009-170008 号、公開日平成 21 年 7 月 30 日、財団法人光産業技術振興協会、大津元一、成瀬誠、川添忠、西林一彦、拒絶査定
28. 「微粒子の堆積方法」、平成 19 年 10 月 12 日出願、特願 2007-267005、特開 2009-97022 号、公開日平成 21 年 5 月 7 日、東京大学、大津元一、八井崇、拒絶査定
29. 「ZnO ナノロッドの堆積方法」、平成 19 年 9 月 26 日出願、特願 2007-248749、特開 2009-78942 号、公開日平成 21 年 4 月 16 日、東京大学、大津元一、八井崇、北村心、みなし取下、平成 22 年 12 月 21 日
30. 「受光素子」、平成 19 年 9 月 3 日出願、特願 2007-228122、特開 2009-60040 号、公開日平成 21 年 3 月 19 日、東京大学、大津元一、川添忠、山崎俊輔、みなし取下、平成 22 年 12 月 21 日
31. 「近接場光学用プローブ」、平成 20 年 6 月 16 日出願、特願 2008-157284、特開 2008-233109、公開日平成 20 年 10 月 2 日、日本分光株式会社、独立行政法人科学技術振興機構、財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田 貴人、井上 勉、中村 高広、大津 元一、拒絶査定

32. 「近接場露光によるレジストパターン形成方法」、平成 18 年 11 月 27 日出願、特願 2006-318071、特開 2008-131024 号、公開日平成 20 年 6 月 5 日、キヤノン株式会社、東京大学、稲生耕久、大津元一、拒絶査定、平成 23 年 4 月 28 日
33. 「光ファイバプローブおよび光ファイバプローブの製造方法、検査装置および検査方法」、平成 18 年 5 月 26 日出願、特願 2006-147064、特開 2007-315963 号、公開日平成 19 年 12 月 6 日、株式会社リコー、独立行政法人科学技術振興機構、株式会社放電精密加工研究所、伊藤泉、大津元一、物部秀二、山元弘治、越川祐美、未審査請求によるみなし取下 処分日 2009.08.25
34. 「露光装置」、平成 18 年 2 月 17 日出願、特願 2006-40401、特開 2007-220933 号、公開日平成 19 年 8 月 30 日、ウシオ電機株式会社、独立行政法人科学技術振興機構、鈴木貴之、蕪木清幸、大津元一、川添忠、拒絶査定
35. 「フォトマスク及びフォトマスクを備えた露光装置」、平成 17 年 12 月 26 日出願、特願 2005-372311、特開 2007-171791 号、公開日平成 19 年 7 月 5 日、ウシオ電機株式会社、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、鈴木貴之、拒絶査定、平成 24 年 12 月 13 日
36. 「フォトマスク及びフォトマスクを備えた露光装置」、平成 17 年 12 月 26 日出願、特願 2005-372310、特開 2007-171790 号、公開日平成 19 年 7 月 5 日、ウシオ電機株式会社、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、鈴木貴之、拒絶査定
37. 「リソグラフィ方法」、平成 17 年 9 月 28 日出願、特願 2005-281144 号、特開 2007-095859 号、公開日平成 19 年 4 月 12 日、独立行政法人科学技術振興機構、大津元一、川添忠、拒絶査定、平成 23 年 11 月 17 日
38. 「無電解めっき方法およびそれ用のセンシタイジング液」、平成 17 年 9 月 1 日出願、特願 2005-253641、特開 2007-063646 号、公開日平成 19 年 3 月 15 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、みなし取下
39. 「薄膜の作製方法、並びに微粒子の堆積方法」、平成 18 年 9 月 25 日出願、特願 2006-259090、特開 2007-044871 号、公開日平成 19 年 2 月 22 日、独立行政法人科学技術振興機構、八井崇、興相元伸、野村航、大津元一、拒絶査定、平成 24 年 5 月 24 日
40. 「量子ドットを用いた光接続装置」、平成 17 年 2 月 7 日出願、特願 2005-030728、特開 2006-215484 号、公開日平成 18 年 8 月 17 日、独立行政法人科学技術振興機構・独立行政法人情報通信研究機構、八井崇、大津元一、成瀬誠、拒絶査定
41. 「光ファイバプローブ、光検出装置及び光検出方法」、平成 17 年 2 月 4 日出願、2005-29652、特開 2006-214942 号、2006/8/17、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、株式会社放電精密加工研究所、伊藤泉、大津元一、物部秀二、山元弘治、越川祐美、拒絶査定、平成 23 年 11 月 11 日
42. 「演算回路」、平成 16 年 7 月 7 日出願、2004-201048、特開 2006-023505 号、公開日平成 18 年 1 月 26 日、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人情報通信研究機構、大津元一、川添忠、成瀬誠、拒絶査定
43. 「近接場光触媒装置」、平成 15 年 11 月 出願、特願 2003-381126 特開 2005-144225 号、平成 17 年 6 月 9 日、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、大津元一、平成 19

年 10 月拒絶査定承服

44. 「光プローブ及び光ピックアップ装置」、平成 15 年 7 月 2 日出願、特願 2003-190065、特開 2005-025860 号、公開日平成 17 年 1 月 27 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、高橋淳一、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
45. 「光プローブ及び光ピックアップ装置」、平成 15 年 6 月 18 日出願、特願 2003-173137、特開 2005-011415 号、公開日平成 17 年 1 月 13 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、高橋淳一、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
46. 「近接場光プローブ」、平成 14 年 10 月出願、特願 2002-303342、特開 2004-138503 号、公開日平成 14 年 10 月 17 日、独立行政法人科学技術振興機構、川添忠、八井崇、大津元一、金太源、拒絶査定
47. 「光ファイバプローブ並びにカンチレバーチップ」、平成 14 年 8 月 22 日出願、特願 2002-241841、特開 2004-077431 号、公開日平成 16 年 3 月 11 日、科学技術振興事業団、林 定植、大津元一、八井崇、川添忠、拒絶査定
48. 「近接場光プローブ」、平成 14 年 6 月 27 日出願、特願 2002-187294、特開 2004-028853 号、公開日平成 16 年 1 月 29 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、藤田俊介、大津元一、拒絶査定承服
49. 「プローブ及びその製造方法」、平成 14 年 3 月 25 日出願、特願 2002-84161、特開 2003-279461 号、公開日平成 15 年 10 月 2 日、科学技術振興事業団、八井崇、興梠元伸、大津元一、吉本護、拒絶査定、平成 19 年 2 月 22 日
50. 「光プローブ及び光ピックアップ」、平成 13 年 10 月 30 日出願、特願 2001-332331、特開 2003-141768 号、公開日平成 15 年 5 月 16 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、高橋淳一、三船博庸、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
51. 「近接場光プローブ及びその製造方法」、平成 13 年 10 月 24 日出願、特願 2001-326144 特開 2003-133581 号、公開日平成 15 年 5 月 9 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、藤田俊介、大津元一、興梠元伸、出願取下擬制
52. 「光プローブ及び光ピックアップ装置」、平成 13 年 10 月 25 日出願、特願 2001-327651 特開 2003-130781 号、公開日平成 15 年 5 月 8 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、高橋淳一、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
53. 「変換素子及び変換方法」、平成 13 年 9 月 27 日出願、特願 2001-297735、特開 2003-107538 号、公開日平成 15 年 4 月 9 日、科学技術振興事業団、川添忠、大津元一、拒絶査定、平成 20 年 4 月 17 日
54. 「強誘電体結晶基板の熱処理方法」、平成 13 年 8 月 31 日出願、特願 2001-263967、特開 2003-073193 号、公開日平成 15 年 3 月 12 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、興梠元伸、大津元一、出願取下擬制
55. 「振動型プローブセンサ」、平成 13 年 8 月 16 日出願、特願 2001-247377、特開 2003-057162、号、公開日平成 15 年 2 月 26 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、八井崇、出願取下擬制

56. 「光化学気相堆積法用プローブ及びその製造方法、並びに光化学気相堆積装置」、平成13年6月5日出願、特願2001-169459、特開2002-361595号、公開日平成14年12月18日、科学技術振興事業団、八井崇、大津元一、興梠元伸、平成16年2月24日拒絶査定承服
57. 「光ファイバ評価方法」、平成13年3月27日出願、特願2001-91200、特開2002-286582号、公開日平成14年10月3日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、出願取下擬制
58. 「無電解めっき方法」、平成13年3月2日出願、特願2001-58309、特開2002-256441号、平成14年9月11日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、日本学術振興会、物部秀二、大津元一、出願取下擬制
59. 「光ピックアップスライダ」、平成13年2月15日出願、特願2001-039028、特開2002-245648号、公開日平成14年8月30日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、八井崇、出願取下擬制
60. 「プローブ及びプローブアレイ」、平成13年7月26日出願、特願2001-226595、特開2002-174587号、公開日平成14年6月21日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、株式会社リコー、八井崇、興梠元伸、大津元一、出願取下擬制
61. 「光ファイバ及びその製造方法」、平成13年5月31日出願、特願2001-145353、特開2002-22979号、公開日平成14年1月23日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、物部秀二、松本拓也、特願2000-360381の分割、財団法人神奈川科学技術アカデミー拒絶査定承服
62. 「近接場プローブ」、平成12年6月9日出願、特願2000-172979、特開2001-351265号、公開日平成13年12月21日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
63. 「近接場平面プローブ」、平成12年6月9日出願、特願2000-172982、特開2001-349818号、公開日平成13年12月21日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、川崎俊之、高橋淳一、福田浩章、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
64. 「位置決め装置、及びそれを用いた近接場光学顕微鏡」、平成12年5月23日出願、特願2000-151529、特開2001-330546号、公開日平成13年11月30日、日本分光株式会社、科学技術振興事業団、財団法人神奈川科学技術アカデミー、成田 貴人、宮島達哉、大津元一、拒絶査定放置
65. 「光情報記録再生装置」、平成12年6月29日出願、特願2000-196575、特開2001-236684号、公開日平成13年8月31日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、高橋淳一、大塚正也、大津元一、興梠元伸、八井崇、出願取下擬制
66. 「プローブアレイ及びプローブアレイの製造方法」、平成11年11月16日出願、特願H11-326169、特開2001-141635号、公開日平成13年5月25日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、株式会社リコー、八井崇、興梠元伸、大津元一、高橋淳一、拒絶査定放置
67. 「光ファイバー、光ファイバープローブ及びその製造方法」、平成11年8月30日出願、特願H11-243932、特開2001-66240号、公開日平成13年3月16日、財団法人神

奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、拒絶査定 2010/01/05

68. 「微細加工装置」、平成 12 年 6 月 19 日出願、特願 2000-183615、特開 2001-062574 号、平成 13 年 3 月 13 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、齋木敏治、腰原伸也、物部秀二、大津元一、宮沢貴士、拒絶査定
69. 「光検出装置及び方法」、平成 11 年 7 月 22 日出願、特願 H11-207776、特開 2001-34980 号、公開日平成 13 年 2 月 9 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、八井崇、大津元一、拒絶査定放置
70. 「光記録再生装置及び方法」、平成 11 年 7 月 5 日出願、特願 H11-190629、特開 2001-23214 号、公開日平成 13 年 1 月 26 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、株式会社リコー、大津元一、興梠元伸、林嘉隆、拒絶査定 2009/3/3
71. 「光ヘッド、再生装置及び方法、記録装置及び方法」、平成 11 年 3 月 26 日出願、特願 H11-83208、特開 2000-276764 号、公開日平成 12 年 10 月 6 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、八井崇、大津元一、拒絶査定放置
72. 「光走査装置」、平成 11 年 2 月 5 日出願、特願 H11-028167、特開 2000-227572 号、公開日平成 12 年 8 月 15 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、川崎俊之、大津元一、興梠元伸、出願取下擬制 2006/5/23
73. 「開口径可変型近接場プローブ」、平成 11 年 2 月 2 日出願、特願 H11-24576、特開 2000-221131 号、公開日平成 12 年 8 月 11 日、工業技術院長、富永淳二、中野隆志、阿刀田伸史、興梠元伸、大津元一、拒絶査定 2001/10/23
74. 「光源用材料」、平成 10 年 12 月 25 日出願、特願 H10-369793、特開 2000-191326 号、公開日平成 12 年 7 月 11 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津元一、興梠元伸、李謹炯 出願取下擬制 2006/3/28
75. 「近接場光プローブ」、平成 10 年 11 月 25 日出願、特願 H10-334505、特開 2000-164915 号、平成 12 年 6 月 16 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、藤田俊介、高橋淳一、大津元一、興梠元伸、出願取下擬制 2006/2/28
76. 「平面型プローブヘッド及び該ヘッドを用いた光記録媒体の記録・再生方法」、平成 10 年 11 月 16 日出願、特願 H10-324779、特開 2000-149303 号、平成 12 年 5 月 30 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大塚正也、川崎俊之、豊島伸朗、工藤宏一、大津元一、興梠元伸、拒絶査定 2004/5/25
77. 「屈折率分布型光プローブ及びその製造方法」、平成 10 年 9 月 2 日出願、特願 H10-248522、特開 2000-76692 号、公開日平成 12 年 3 月 14 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、豊島伸朗、川崎俊之、大塚正也、大津元一、興梠元伸、出願取下擬制 2006/1/24
78. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成 10 年 7 月 21 日出願、特願 H10-205043、特開 2000-39389 号、平成 12 年 2 月 8 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、渡辺和巳、興梠元伸、大津元一、拒絶査定 2008/04/08
79. 「物性検出装置」、平成 10 年 7 月 6 日出願、特願 H10-190600、特開 2000-20960 号、公開日平成 12 年 1 月 21 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元

一、拒絶査定 2008/07/01

80. 「光ピックアップの作製方法」、平成 10 年 6 月 23 日出願、特願 H10-192445、特開 2000-11438 号、公開日平成 12 年 1 月 14 日、株式会社リコー、財団法人神奈川科学技術アカデミー、高橋淳一、大津元一、興梠元伸、出願取下擬制 2005/09/27
81. 「光触針の制御方法」、平成 10 年 3 月 27 日出願、特願 H10-100665、特開平 11-281656 号、公開日平成 11 年 10 月 15 日、日本分光株式会社、科学技術振興事業団、財団法人神奈川科学技術アカデミー、渡辺伸一郎、池田照樹、大津元一、拒絶査定 2007/8/14
82. 「レーザ光発生装置及び方法」、平成 10 年 3 月 26 日出願、特願 H10-79712、特開平 11-274626 号、公開日平成 11 年 10 月 8 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、拒絶査定 2003/7/29
83. 「レーザ光制御装置及び方法」、平成 10 年 3 月 24 日出願特願 H10-75736、特開平 11-271816 号、平成 11 年 10 月 8 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、大津元一、拒絶査定 1999/11/9
84. 「光照射方法及び光検出方法並びにデータ記録方法、データ再生方法、データ記録装置及びデータ再生装置」、平成 10 年 3 月 13 日出願、特願平 10-63517、公開日平成 11 年 9 月 24 日、特開平 11-259890 号、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、八井崇、大津元一、拒絶査定 1999/10/5
85. 「平面プローブアレイによるトラッキングレス超高速・光再生方法」、平成 9 年 12 月 26 日出願、特願 H09-359428、特開平 11-191238 号、公開日平成 11 年 7 月 13 日、東京工業大学長、興梠元伸、筒井一生、大津元一、拒絶査定 2002/2/12
86. 「平面プローブ及びその製造方法」、平成 9 年 9 月 30 日出願、特願 H09-266869、特開平 11-110792 号、公開日平成 11 年 4 月 23 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、興梠元伸、八井崇、大津元一、拒絶査定 2000/6/13
87. 「光ファイバの評価方法」、平成 9 年 9 月 30 日出願、特願 H09-266871 特開平 11-108798 号、公開日平成 11 年 4 月 23 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部秀二、大津元一、拒絶査定 2006/4/4、
88. 「加熱装置」、平成 9 年 9 月 26 日出願、特願 H09-262147、特開平 11-101840 号、公開日、平成 11 年 4 月 13 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、斎木敏治、大津元一、拒絶査定 2000/10/17
89. 「反射測定装置用の光学系並びにそれを用いた分光光度計」、平成 9 年 1 月 17 日、特願 H09-19690、特開平 10-206332 号、公開日平成 10 年 8 月 7 日、日本分光株式会社、科学技術振興事業団、財団法人神奈川科学技術アカデミー、渡辺伸一郎、大津元一、拒絶査定 2006/02/28
90. 「光ファイバー、光ファイバースプロブ及びその製造方法」、平成 8 年 9 月 6 日出願、特願 H8-236786、特開平 10-82791 号、公開日平成 10 年 3 月 31 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、物部 秀二、大津 元一、拒絶査定、平成 16 年 11 月 11 日
91. 「記録媒体及びその製造方法、記録方法及び記録装置」、平成 6 年 12 月 6 日出願、特願平 06-301936、特開平 08-160564、公開日平成 8 年 6 月 21 日、財団法人神奈川科学

技術アカデミー、福田 浩章、ルジェロ ミケレット、大津 元一、平成 14 年 3 月 26 日、みなし取下

92. 「基盤及びその製造方法、光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成 6 年 12 月 6 日出願、特願平 06-301937、特開平 08-160225 号、公開日平成 8 年 6 月 21 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、ルジェロ ミケレット、福田 浩章、大津 元一、平成 14 年 3 月 26 日みなし取下
93. 「周波数安定化レーザー装置」、平成 6 年 3 月 11 日出願、特願平 06-066468、特開平 07-249819 号、公開日平成 7 年 9 月 26 日、財団法人電力中央研究所、藤井 隆、根本孝七、大津 元一、興梠 元伸、拒絶査定
94. 「光ファイバプローブ及びその製造方法」、平成 5 年 11 月 22 日出願、特願平 05-291829、特開平 7-146126 号、公開日平成 7 年 6 月 6 日、財団法人神奈川科学技術アカデミー、大津 元一、平成 16 年 11 月 4 日、拒絶査定
95. 「レーザ発振装置と、そのレーザ発振装置を用いた色彩計測用の光源」、平成 5 年 3 月 8 日出願、特願平 05-046400、特開平 06-258141 号、公開日平成 6 年 9 月 16 日、株式会社クボタ、岡本 匡史、園田 秀二、大津 元一、拒絶査定
96. 「光ファイバジャイロスコープ」、平成 3 年 11 月 13 日出願、特願平 03-325369、特開平 06-235641 号、公開日平成 6 年 8 月 23 日、東京航空計器株式会社、新技術事業団、東京工業大学長、今井 亨、大津 元一、拒絶査定
97. 「原子間力顕微鏡一体型フォトン走査型トンネル顕微鏡」、特願平 04-312547、平成 4 年 11 月出願、特開平 06-160719 号、公開日平成 6 年 6 月 7 日、株式会社ニコン、大澤 日佐雄、大津 元一、蔣 曙東、平成 12 年 2 月 22 日みなし取下げ
98. 「狭帯域スペクトルレーザー光発生装置」、平成 3 年 8 月 12 日出願、特願平 03-225350、特開平 05-048212 号、公開日平成 5 年 2 月 26 日、財団法人電力中央研究所、藤井 隆、根本 孝七、大津 元一、平成 10 年 1 月 24 日みなし取下げ

(ア) 再公表特許 (A1)

99. 「光検出装置及び方法」、特願 2005-511415 号、国際出願番号 PCT/JP2004/009748、国際出願日 平成 16 年 7 月 8 日、優先権主張番号 特願 2003-193680、優先日 平成 15 年 7 月 8 日、国際公開日 平成 17 年 1 月 13 日、国際公開番号 W02005/003737
100. 「酸化亜鉛ナノ細線の近接場光触媒」、特願 2008-528919、出願日平成 17 年 8 月 31 日、特表 2009-505829、公表日 平成 21 年 2 月 12 日、翻訳文提出日平成 20 年 3 月 4 日、国際出願番号 PCT/KR2005/002882、国際公開番号 W02007/026974、国際公開日平成 19 年 3 月 8 日、出願人ポストック・ファウンデーション、国立大学法人 東京大学、発明者 イ、ギューチュル、大津 元一、八井 崇、拒絶査定

出願中

1. 「光変調方法、光変調器の作製方法、光変調器」、2014 年 8 月 5 日出願、特願 2014-159410 号、特定非営利活動法人ナノフォトニクス工学推進機構、大津元一、川添忠、堅直也

2. 「表面平坦化方法及び表面平坦化システム」、2014年2月26日出願、特願2014-035928号、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、大津元一、八井崇
3. 「金属板の表面平坦化方法及び装置」、2013年6月10日出願、特願2013-121707号、国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、野村航、八井崇、みなし取下げ 平成28年3月8日
4. 「信号分配器、信号混合器」、2013年4月15日出願、特願2013-84674号、特定非営利活動法人ナノフォトンクス工学推進機構、大津元一、八井崇、川添忠、野村航
5. 「エレクトロルミネッセンス素子及びその作製方法」、2011年2月18日出願、特願2011-033987号、国立大学法人東京大学、大津元一、川添忠、(ムイドエムエイ削除)、国内優先による取下
6. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成21年5月1日出願、特願2009-112126号、みなし取下
7. 「反射型光走査トンネル顕微鏡」、特願平 02-079735、科学技術振興事業団、大津元一、国内優先による取下

国外特許

登録済

125. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成22年4月28日出願、出願国 中華人民共和国、出願番号 201080018835.X、東大知財番号 13B094004-1、大津元一、八井崇、川添忠、山崎俊輔、梶山康一、米村通伸、伊藤圭一、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー、登録日2015年06月24日、登録番号 ZL201080018835.X
126. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成22年4月28日出願、出願国 アメリカ合衆国、出願番号 13/266/337、東大知財番号 13B094004-1、大津元一、八井崇、川添忠、山崎俊輔、梶山康一、米村通伸、伊藤圭一、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー、登録日2014年12月16日、Patent No. US 8,912,079 B2
127. 「受光素子の作製方法、受光素子の作成装置」、平成21年3月2日出願、出願国 中華人民共和国、出願番号 201080035324.9、大津元一、八井崇、川添忠、行武壮太郎、登録日平成26年8月6日、登録番号 2014060900312960、権利放棄(平成26年10月17日)
128. 「信号波形測定装置及び測定方法」、平成21年8月31日出願、出願国 アメリカ合衆国、出願番号 12/550,895、東大知財番号 13B08Y006-1、大津元一、藤原弘康、川添忠
129. 「信号波形測定装置及び測定方法」、平成21年3月2日出願、出願国 中華人民共和

- 国、出願番号 200910254052.0、東大知財番号 13B08Y006-1、大津 元一、藤原 弘康、川添 忠、登録日平成 25 年 1 月 16 日、登録番号 ZL200910254052.0
130. 「波長変換光生成装置及び生成方法」、平成 20 年 3 月 26 日出願、出願国 中華人民共和国、出願番号 200910129531.X、東大知財番号 13B082005-1、大津 元一、川添 忠、藤原 弘康
131. 「波長変換光生成装置及び生成方法」、平成 20 年 3 月 26 日出願、出願国 アメリカ合衆国、出願番号 12/410871、東大知財番号 13B082005-1、大津 元一、川添 忠、藤原 弘康、 “Wavelength-Converted Light Generating Apparatus and Generating Method” 2009 年 3 月 25 日出願、12/410871、特許公開番号 US7764421B2、特許公開 2010 年 7 月 27 日、H. Fujiwara, T. Kawazoe, M. Ohtsu,
132. “Optical-pickup slide, manufacturing method thereof, probe and manufacturing method thereof, and probe array and manufacturing method thereof” Appl. Date December 6, 2005, Appl No. 11/294474, Issue No. US 7489616, Issue Date February 10, 2009, 出願国 米国 (「光ピックアップスライダ及びその製造方法」、平成 12 年 4 月 26 日出願、特願 2000-125127 号、公開日平成 13 年 4 月 6 日、特開 2001-93251 号(特許登録日平成 17 年 2 月 25 日 : 特許第 3649648 号), Takahashi Junichi, Kourog Motonobu, Takashi Yatsui, Ohtsu Motoichi,
133. “Near field optical probe having an internal near field generating and detecting device, and manufacturing method thereof” , Appl. Date. December 2, 2002, Appl No 10/307438, Issue No. US 6995350, Issue Date, February 7, 2006, 出願国 米国, Fujita Shunsuke, Takahashi Junichi, Ohtsu Motoichi, Kourog Motonobu
134. “Method of manufacturing a probe array” , Appl. Date. November 25, 2003, Appl. No. 10/720444, Issue No. US 6993826, Issue Date, February 7, 2006, 出願国 米国 (「光ピックアップスライダ及びその製造方法、プローブ、その製造方法、プローブアレイ及びその製造方法」, 日本、平成 12 年 4 月出願、特開 2001-208672 号) Ohtsu Motoichi, Kourog Motonobu, Yatsui Takashi
135. “Optical-pickup slider, manufacturing method thereof, probe and manufacturing method thereof, and probe array and manufacturing method thereof ” Appl. Date June 2, 2000, Appl No 09/585428, Issue No US 6680900, Issue Date, January 20, 2004, 出願国 米国, (「光ピックアップスライダ及びその製造方法、プローブ、その製造方法、プローブアレイ及びその製造方法」日本、平成 10 年 6 月 4 日出願、特願 H11-157699 号, 特許 号 登録日 2004 年 1 月 20 日) , Ohtsu Motoichi, Kourog Motonobu, Yatsui Takashi
136. “Probe opening forming apparatus and near-field optical microscope using the same” , Appl. Date May 21, 2001, Appl No. 09/860643, 公開番号 US2001-0048063, 公開日 December 6, 2001, Issue No. US 6617569, Issue Date. March 9, 2003, 出願国 米国 (「プローブ開口作製装置」、及びそれを用いた近接場光学顕微鏡、平成 13 年 5 月 29 日出願、特願 2000-158560, 公開番号 US-2001-0048068) Ohtsu Motoichi, Saiki Toshiharu, Mononobe Shuji
137. “Near field optical probe and manufacturing method thereof” Appl. Date. November 24, 1999, Appl No. 09/448152, Issue No. US 6541755, Issue Date. April

- 1, 2003, 出願国 米国 (「近接場光プローブ及びその製造方法」、平成 11 年 11 月 25 日出願、特願 H10-334505,) Ohtsu Motoichi, Kouroggi Motonobu
138. “Interference detecting apparatus and tomography apparatus” Appl. Date. February 16, 2001, Appl No. 09/784000, Issue No. US 6493091, Issue Date. December 10, 2002, 出願国 米国, (日本 特願 2000-046831, 2000, 2, 18) Kouroggi Motonobu, Ohtsu Motoichi
139. “Rotating probe microscope” Appl. Date. May 17, 2000, Appl No. 09/573636, Issue No. US 6470738, Issue Date. October 29, 2002, 出願国 EPC 欧州 (「プローブ顕微鏡」, (日本 特願 H11-143519, 1999, 6, 1 公開 特開 2001-33209, 2001, 2, 9) Narita Yoshihito, Hisada Hideho, Miyajima Tatsuya, Saito Osamu, Watanabe Shinichiro, Saito Shinya, Akutsu Koji, Teruyama Susumu Ohtsu Motoichi
140. “Scanning probe microscope” 出願番号. EP 00110273.0, 公開番号 EP1055901, 特許番号 EP1055901, 出願国 EPC 欧州 (「プローブ顕微鏡」, 日本 (特願 H11-143519, 1999, 6, 1 公開 特開 2001-33209, 2001, 2, 9) Narita Yoshihito, Hisada Hideho, Miyajima Tatsuya, Saito Osamu, Watanabe Shinichiro, Saito Shinya, Akutsu Koji, Teruyama Susumu Ohtsu Motoichi
141. “Variable-aperture optical near-field probe” Appl. Date. February 2, 2000, Appl No. 09/496050, Issue No. US 6340813, Issue Date. January 22, 2002, 出願国 米国, Tominaga Junji, Nakano Takashi, Atoda Nobufumi, Kouroggi Motonobu, Ohtsu Motoichi
142. “Optical fiber probe and manufacturing method therefor” Appl. Date. November 18, 1998, Appl No. 09/180975, Issue No. US 6236783, Issue Date. May 22, 出願国 米国 2001 年, (「光ファイバプローブ及びその製造方法」, 日本 (特許第 号)) Mononobe Shuji, Ohtsu Motoichi
143. “Method for optical fiber with tapered end core protruding from clad” Appl. Date. June 9, 1998, Appl No. 09/095352, Issue No. US 5928525, Issue Date July 27, 1999, 出願国 米国 (「光ファイバ及びその製造方法」, 平成 10 年 6 月出願、特許番号), Ohtsu Motoichi, Mononobe Shuji, Rajagopalan Uma Mahaswari
144. “Method for producing optical fiber having core with sharpened tip protruding from light-shielding coating” Appl. Date. May 12, 1998, Appl No. 09/076880, Issue No. US 5908562, Issue Date. June 1, 1999, 出願国 米国 (「光ファイバ及びその製造方法」, 日本 (特許第 号)), Ohtsu Motoichi, Mononobe Shuji, Matsumoto Takuya, Saiki Toshiharu
145. “Optical fiber having core with sharpened tip protruding from light-shielding coating” Appl. Date 12, 1997, 08/737605, Issue No. US5812724, Issue Date. September 22, 1998, 出願国 米国 (「光ファイバ及びその製造方法」, 日本 (特許第 号)), Ohtsu Motoichi, Mononobe Shuji, Matsumoto Takuya, Saiki Toshiharu
146. “Optical fiber with tapered end of core protruding from clad” 出願日 January 17, 1997, 出願番号 08/704615, 公開日, 公開番号, 登録番号 US5812723, 登録日. September 22, 1998, 出願国 米国 (「光ファイバ及びその製造方法」, 日本、平成 6 年 5 月 3 1 日出願、特願平 6-117766、(特許第 3023048 号)), Ohtsu Motoichi, Mononobe

Shuji, Rajagopalan Uma Mahaswari

147. “Method for controlling movement of neutral atom and apparatus for carrying out the same” Appl. Date February 25, 1993, Appl No. 08/022519, Issue No. US5337324, Issue Date. August 9, 1994, 出願国 米国, Ohtsu Motoichi, Hori Hirokazu,
148. “Harmonic wave generator, a method of producing a harmonic wave and a reading apparatus for an optical recording medium using the harmonic wave generator or the method of producing a harmonic wave” Appl. Date April 12, 1993, Appl No. 08/047032, Issue No. US5274652, Issue Date. December 28, 1993, 出願国 米国, Senoh Tadanori, Tanabe Yuzuru, Ohtsu Motoichi,
149. “Laser pumped atomic frequency standard with high frequency stability” Appl. Date August 29, 1991, Appl No. 07/754268, Issue No. US5148437, Issue Date. September 15, 1992, 出願国 米国, Ohtsu Motoichi
150. “Optical fiber and its manufacture” 出願日 May 31, 1995, 出願番号 EP95920231.8, 公開日 March 19, 1997, 公開番号 EP0763742, 登録日 March 6, 1998, 登録番号 EP0763742, EPC 欧州, (「光ファイバプローブの製造方法及び光ファイバプローブ」、日本、平成6年5月31日出願、特願平6-117766、出願取下(優先権基礎)Ohtsu Motoichi, Mononobe, Shuji, Matsumoto Takuya, Saiki Toshiharu

公開中

151. “Optical Fiber Probe, Optical Detection Device, And Optical Detection Method,” (特許公開番号 20080073518) 2008年3月27日出願, Itho Izumi, Takada Masato Terashi Taroh, Ohtsu Motoichi, Yatsui Takashi, Kourog Motonobu,
152. “Near-field photocatalyst including zinc oxide nanowire,” (Publication Number: WO/2007/026974, International Application No. PCT/KR2005/002882) 2005年8月31日出願, 2007年3月8日公開
153. “Microscope” 特許公開番号 20010017054, August 30 2001, 米国 (「顕微鏡」, 日本) Narita Yoshihito, Hisada Hideho, Miyajima Tatsuya, Saito Osamu, Watanabe Shinichiro, Saito Shinya, Akutsu Koji, Teruyama Susumu, Ohtsu Motoichi
154. “Rangefinder” 2000年5月15日出願, 09/570944, 特許公開番号 US20010017696, 特許公開 2001年8月30日, Motoichi Ohtsu 「距離計」、平成12年5月出願, Narita Yoshihito, Hisada Hideho, Ohtsu Motoichi
155. “VIBRATION TYPE PROBE SENSOR” 2002年8月14日出願, PCT/JP2002/008274, 特許公開番号 WO/2003/016874, 特許公開 2003年2月27日「振動型プローブセンサ」、平成14年8月出願、特願 2001-247377, Kourog Motonobu, Ohtsu Motoichi, Yatsui Takashi

出願中

156. 「受発光素子」、平成 25 年 2 月 22 日出願、出願国 世界知的所有権機関 (W I P O)、出願番号 PCT/JP2013/001008、(W02014030268A1、2014. 2. 27)、杉森輝彦、大津元一、川添忠、出願人特定非営利活動法人ナノフォトニクス工学推進機構
157. 「受光素子の作製方法、受光素子の作製装置」、平成 24 年 5 月 24 日出願、出願国 アメリカ合衆国、出願番号 13/511, 734、大津元一、八井崇、川添忠、行武壮太郎、出願人独立行政法人科学技術振興機構、出願放棄
158. 「受光素子の作製方法、受光素子の作製装置」、平成 22 年 11 月 24 日出願、出願国 世界知的所有権機関 (W I P O)、出願番号 PCT/JP2010/006858、大津元一、八井崇、川添忠、行武壮太郎、出願人独立行政法人科学技術振興機構
159. 「受光素子の作製方法、受光素子の作製装置」、平成 22 年 11 月 24 日出願、出願国 ドイツ、出願番号 11 2010 004 544. 5、大津元一、八井崇、川添忠、行武壮太郎、出願人独立行政法人科学技術振興機構、出願放棄
160. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成 22 年 4 月 30 日出願、出願国 台湾、出願番号 99113883、東大知財番号 13B 094004-1、大津 元一、八井 崇、川添 忠、山崎 俊輔、梶山 康一、米村 通伸、伊藤 圭一、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー
161. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成 22 年 4 月 28 日出願、出願国 世界知的所有権機関 (W I P O)、出願番号 PCT/JP2010/003067/002882、東大知財番号 13B 094004-1、大津 元一、八井 崇、川添 忠、山崎 俊輔、梶山 康一、米村 通伸、伊藤 圭一、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー
162. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成 22 年 4 月 28 日出願、出願国 大韓民国、出願番号 10-2011-7020985、東大知財番号 13B 094004-1、大津 元一、八井 崇、川添 忠、山崎 俊輔、梶山 康一、米村 通伸、伊藤 圭一、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー
163. 「化合物半導体の堆積方法及び装置」、平成 22 年 4 月 28 日出願、出願国 欧州特許条約(EPC)、出願番号 10769521. 5、東大知財番号 13B 094004-1、大津 元一、八井 崇、川添 忠、山崎 俊輔、梶山 康一、米村 通伸、伊藤 圭一、出願人国立大学法人東京大学、株式会社ブイ・テクノロジー、出願放棄
164. “SIGNAL WAVEFORM MEASURING APPARATUS AND MEASURING METHOD”、「信号波形測定装置及び測定方法」、平成 21 年 8 月 31 日出願、出願国 アメリカ合衆国、出願番号 US 12/550895、東大知財番号 13B 08Y 006-1、大津 元一、藤原 弘康、川添 忠
165. 「酸化亜鉛ナノ細線を用いた近接場光触媒」、平成 17 年 8 月 31 日出願、出願国 中華人民共和国、出願番号 200580051456. X、東大知財番号 1304Z031-1、大津 元一、八井 崇、李 奎哲
166. 「酸化亜鉛ナノ細線を用いた近接場光触媒」、平成 17 年 8 月 31 日出願、出願国 大韓民国、出願番号 110-2008-7004664、東大知財番号 1304Z031-1、大津 元一、八井 崇、李 奎哲

167. 「酸化亜鉛ナノ細線を用いた近接場光触媒」、平成 17 年 8 月 31 日出願、出願国 アメリカ合衆国、出願番号 12/004816、東大知財番号 1304Z031-1、大津 元一、八井 崇、李 奎哲
168. 「酸化亜鉛ナノ細線を用いた近接場光触媒」、平成 17 年 8 月 31 日出願、出願国 世界知的所有権機関(W I P O)、出願番号 PCT/KR05/002882、東大知財番号 1304Z031-1、大津 元一、八井 崇、李 奎哲
169. “Optical Fiber Probe, Optical Detection Device, And Optical Detection Method,” (特許公開番号) 2006 年 2 月 2 日出願、出願国 欧州、出願番号 EP6713348.8、K P 整理番号 KP06F-67-PCT-CN, Itho Izumi, Takada Masato Terashi Taroh, Ohtsu Motoichi, Yatsui Takashi, kouroggi Motonobu, 出願人
170. “Optical Fiber Probe, Optical Detection Device, And Optical Detection Method,” (特許公開番号) 2006 年 2 月 2 日出願、出願国 中華人民共和国、出願番号 CN200680000201.5、K P 整理番号 KP06F-67-PCT-CN, Itho Izumi, Takada Masato Terashi Taroh, Ohtsu Motoichi, Yatsui Takashi, kouroggi Motonobu, 出願人